



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115213791 A

(43) 申请公布日 2022. 10. 21

(21) 申请号 202210703884.1

B24B 47/12 (2006.01)

(22) 申请日 2022.06.21

(71) 申请人 南京彼奥电子科技有限公司

地址 210000 江苏省南京市经济技术开发区  
兴联路6号

(72) 发明人 钟进科 黄云霞 龚则明

(74) 专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320

专利代理师 徐科飞

(51) Int. Cl.

B24B 29/02 (2006.01)

B24B 27/06 (2006.01)

B24B 41/00 (2006.01)

B24B 55/06 (2006.01)

B24B 41/06 (2012.01)

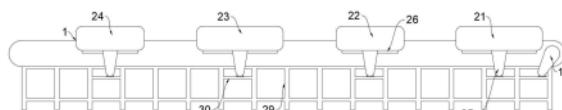
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

### (54) 发明名称

一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机及其抛光方法

### (57) 摘要

本发明公开了一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机及其抛光方法,涉及微波铁氧体技术领域,为解决现有铁氧体介质陶瓷片加工磨粒流抛光时产品损坏率较高,使用砂磨机抛光时翻转陶瓷片较为麻烦,在处理大批量铁氧体介质陶瓷片时效率较低的问题。所述自动翻转砂磨抛光机的中间设置有传送机构,传动带,其设置在传送机构的中间,所述传动带上设置有多陶瓷片传送格,陶瓷片翻转垫板,其设置在传动带的内部,所述陶瓷片翻转垫板的上方内部设置有六个第一翻转槽,第一平面抛光机构,其设置在传送机构的上方前端,所述第一平面抛光机构的后方设置有第一侧边抛光机构,所述第一侧边抛光机构的后方设置有第二平面抛光机构。



1. 一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机,包括自动翻转砂磨抛光机(1),所述自动翻转砂磨抛光机(1)的中间设置有传送机构(33);

其特征在于:还包括:

传动带(2),其设置在传送机构(33)的中间,且传动带(2)与传送机构(33)的转轴啮合连接,所述传动带(2)上设置有多个陶瓷片传送格(3),且传动带(2)与陶瓷片传送格(3)为一体结构,所述传动带(2)的内部设置有多个漏水孔(34),且传动带(2)与内部的漏水孔(34)为一体结构;

陶瓷片翻转垫板(4),其设置在传动带(2)的内部,且陶瓷片翻转垫板(4)与传送机构(33)焊接连接,所述陶瓷片翻转垫板(4)的上方内部设置有六个第一翻转槽(6),且六个第一翻转槽(6)与陶瓷片翻转垫板(4)为一体结构,且陶瓷片翻转垫板(4)的内部设置有多漏水孔(34),且陶瓷片翻转垫板(4)与内部的漏水孔(34)为一体结构;

第一平面抛光机构(21),其设置在传送机构(33)的上方前端,所述第一平面抛光机构(21)的后方设置有第一侧边抛光机构(22),所述第一侧边抛光机构(22)的后方设置有第二平面抛光机构(23),所述第二平面抛光机构(23)的后方设置有第二侧边抛光机构(24),且第一平面抛光机构(21)、第一侧边抛光机构(22)、第二平面抛光机构(23)和第二侧边抛光机构(24)均通过螺钉与传送机构(33)连接。

2. 根据权利要求1所述的一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机,其特征在于:所述第一平面抛光机构(21)、第一侧边抛光机构(22)、第二平面抛光机构(23)和第二侧边抛光机构(24)的下方中间均设置有抛光轮(27),所述抛光轮(27)的上方设置有喷水口(28)。

3. 根据权利要求1所述的一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机,其特征在于:所述第一平面抛光机构(21)、第一侧边抛光机构(22)、第二平面抛光机构(23)和第二侧边抛光机构(24)的一侧下方均设置有抛光传动机构(25),且四个抛光传动机构(25)分别与四个抛光机构链条连接,四个所述抛光传动机构(25)的另一侧下方均设置有旋转电机(19),且四个抛光传动机构(25)均与另一侧下方的旋转电机(19)轴连接,所述抛光传动机构(25)的前后端均设置有抛光机构定位台(26),且抛光机构定位台(26)与传送机构(33)焊接连接。

4. 根据权利要求1所述的一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机,其特征在于:所述传送机构(33)的下方设置有砂磨机架(29),且砂磨机架(29)通过螺钉与传送机构(33)连接,所述传送机构(33)的一侧前端设置有传送传动机构(18),且传送传动机构(18)与传送机构(33)的转轴链条连接,且传送传动机构(18)的另一侧下方设置有旋转电机(19),且传送传动机构(18)与另一侧下方的旋转电机(19)轴连接。

5. 根据权利要求3所述的一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机,其特征在于:所述旋转电机(19)的下方设置有电机固定座(20),且旋转电机(19)与电机固定座(20)嵌入式连接,所述电机固定座(20)的下方设置有电机台(30),且电机固定座(20)通过螺钉与电机台(30)连接,且电机台(30)与砂磨机架(29)焊接连接。

6. 根据权利要求1所述的一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机,其特征在于:所述传送机构(33)的下方设置有集水箱(31),且集水箱(31)与砂磨机架(29)焊接连接,所述集水箱(31)的前端设置有出水口(32),且出水口(32)与集水箱(31)为一体结构。

7. 根据权利要求1所述的一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机,其特征在于:所述第一翻转槽(6)的前方设置有第一滑动面(5),且第一滑动面(5)与陶瓷片翻转垫板(4)为一体

结构,所述第一翻转槽(6)的后端设置有第二滑动面(7),且第二滑动面(7)与陶瓷片翻转垫板(4)为一体结构,所述第二滑动面(7)的后端设置有六个第二翻转槽(8),且六个第二翻转槽(8)与陶瓷片翻转垫板(4)为一体结构。

8.根据权利要求1所述的一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机,其特征在于:所述第一翻转槽(6)与第二翻转槽(8)的内部前端均一体设置有第一导斜面(9),所述第一导斜面(9)的后端设置有直立面(11),所述第一导斜面(9)的一侧设置有第一限制面(10),所述第一限制面(10)的后端设置有第一压制面(12),所述直立面(11)与第一压制面(12)之间的后端设置有直立导轨(13),所述直立导轨(13)的后端另一侧设置有第二压制面(14),所述第二压制面(14)的一侧设置有第二导斜面(15),所述第二压制面(14)的后端设置有第二限制面(16),所述第二导斜面(15)的后端设置有导平面(17)。

9.一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机的抛光方法,基于权利要求1-8任意一项所述一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机实现,其特征在于,包括如下步骤:

步骤一:将介质陶瓷片放入陶瓷片传送格(3)内,启动旋转电机(19),带动传动带(2)与抛光轮(27)转动,同时喷水口(28)喷出水;

步骤二:陶瓷片经过第一平面抛光机构(21)的下方,抛光轮(27)转动对陶瓷片的第一面进行打磨抛光,喷水口(28)喷出的水将打磨产生的灰尘带走,通过漏水孔(34)流入下方的集水箱(31)内,通过出水口(32)排走;

步骤三:传动带(2)转动带动陶瓷片传送格(3)内的陶瓷片向后移动,进入第一翻转槽(6)内,陶瓷片的一侧向下陷入第一导斜面(9)内,另一侧继续被陶瓷片传送格(3)带动向后移动,陶瓷片逐渐进入第一压制面(12)的下方,直立面(11)将陶瓷片的另一侧抬起,使陶瓷片逐渐立起进入直立导轨(13)内,陶瓷片被带动经过第一侧边抛光机构(22)的下方,边角被抛光轮(27)打磨抛光,喷水口(28)喷出的水将打磨产生的灰尘带走,通过漏水孔(34)流入下方的集水箱(31)内,通过出水口(32)排走;

步骤四:陶瓷片继续向后移动,上方被第二压制面(14)向一侧压,陶瓷片的另一侧旋转至第二限制面(16),从第一翻转槽(6)内脱离后,陶瓷片的第二面被翻转至上方,经过第二平面抛光机构(23)的下方,抛光轮(27)将陶瓷片的第二面打磨抛光,喷水口(28)喷出的水将打磨产生的灰尘带走,通过漏水孔(34)流入下方的集水箱(31)内,通过出水口(32)排走;

步骤五:陶瓷片继续向后移动,移动至第二翻转槽(8)处,重复步骤三,将陶瓷片的另一侧也打磨完成,重复步骤四,将陶瓷片翻转,移动至传动带(2)末尾,将陶瓷片收集即可。

## 一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机及其抛光方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及微波铁氧体技术领域,具体为一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机及其抛光方法。

### 背景技术

[0002] 铁氧体介质陶瓷片是一种应用于微波频段电路中作为介质材料并完成一种或多种功能的陶瓷材料,在其生产过程中需要用到磨粒流抛光机或砂磨机对其进行打磨抛光。

[0003] 例如公告号为CN213319397U的中国版权专利(一种台式砂磨机),工作台两端设有主动轮与从动轮,主动轮与从动轮设置于槽孔中,主动轮一端穿过第一轴承并与转轮相连接,工作台下端设有电机,电机与转轮通过皮带连接,工作台侧壁上对称设置有挡台,穿过挡台设有调节柱,调节柱一端设有轴套,轴套内设有第二轴承,从动轮两端穿过横槽并设置于第二轴承中,主动轮与从动轮之间设有砂布。

[0004] 但是,上述现有技术磨粒流抛光时产品损坏率较高,使用砂磨机抛光时翻转陶瓷片较为麻烦,在处理大批量铁氧体介质陶瓷片时效率较低;因此,不满足现有的需求,对此我们提出了一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机及其抛光方法。

### 发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机及其抛光方法,以解决上述背景技术中提出的现有铁氧体介质陶瓷片加工磨粒流抛光时产品损坏率较高,使用砂磨机抛光时翻转陶瓷片较为麻烦,在处理大批量铁氧体介质陶瓷片时效率较低的问题。

[0006] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机,包括自动翻转砂磨抛光机,所述自动翻转砂磨抛光机的中间设置有传送机构;

[0007] 还包括:

[0008] 传动带,其设置在传送机构的中间,且传动带与传送机构的转轴啮合连接,所述传动带上设置有多个陶瓷片传送格,且传动带与陶瓷片传送格为一体结构,所述传动带的内部设置有多个漏水孔,且传动带与内部的漏水孔为一体结构;

[0009] 陶瓷片翻转垫板,其设置在传动带的内部,且陶瓷片翻转垫板与传送机构焊接连接,所述陶瓷片翻转垫板的上方内部设置有六个第一翻转槽,且六个第一翻转槽与陶瓷片翻转垫板为一体结构,且陶瓷片翻转垫板的内部设置有多个漏水孔,且陶瓷片翻转垫板与内部的漏水孔为一体结构;

[0010] 第一平面抛光机构,其设置在传送机构的上方前端,所述第一平面抛光机构的后方设置有第一侧边抛光机构,所述第一侧边抛光机构的后方设置有第二平面抛光机构,所述第二平面抛光机构的后方设置有第二侧边抛光机构,且第一平面抛光机构、第一侧边抛光机构、第二平面抛光机构和第二侧边抛光机构均通过螺钉与传送机构连接。

[0011] 优选的,所述第一平面抛光机构、第一侧边抛光机构、第二平面抛光机构和第二侧

边抛光机构的下方中间均设置有抛光轮,所述抛光轮的上方设置有喷水口。

[0012] 优选的,所述第一平面抛光机构、第一侧边抛光机构、第二平面抛光机构和第二侧边抛光机构的一侧下方均设置有抛光传动机构,且四个抛光传动机构分别与四个抛光机构链条连接,四个所述抛光传动机构的另一侧下方均设置有旋转电机,且四个抛光传动机构均与另一侧下方的旋转电机轴连接,所述抛光传动机构的前后端均设置有抛光机构定位台,且抛光机构定位台与传送机构焊接连接。

[0013] 优选的,所述传送机构的下方设置有砂磨机架,且砂磨机架通过螺钉与传送机构连接,所述传送机构的一侧前端设置有传送传动机构,且传送传动机构与传送机构的转轴链条连接,且传送传动机构的另一侧下方设置有旋转电机,且传送传动机构与另一侧下方的旋转电机轴连接。

[0014] 优选的,所述旋转电机的下方设置有电机固定座,且旋转电机与电机固定座嵌入式连接,所述电机固定座的下方设置有电机台,且电机固定座通过螺钉与电机台连接,且电机台与砂磨机架焊接连接。

[0015] 优选的,所述传送机构的下方设置有集水箱,且集水箱与砂磨机架焊接连接,所述集水箱的前端设置有出水口,且出水口与集水箱为一体结构。

[0016] 优选的,所述第一翻转槽的前方设置有第一滑动面,且第一滑动面与陶瓷片翻转垫板为一体结构,所述第一翻转槽的后端设置有第二滑动面,且第二滑动面与陶瓷片翻转垫板为一体结构,所述第二滑动面的后端设置有六个第二翻转槽,且六个第二翻转槽与陶瓷片翻转垫板为一体结构。

[0017] 优选的,所述第一翻转槽与第二翻转槽的内部前端均一体设置有第一导斜面,所述第一导斜面的后端设置有直立面,所述第一导斜面的一侧设置有第一限制面,所述第一限制面的后端设置有第一压制面,所述直立面与第一压制面之间的后端设置有直立导轨,所述直立导轨的后端另一侧设置有第二压制面,所述第二压制面的一侧设置有第二导斜面,所述第二压制面的后端设置有第二限制面,所述第二导斜面的后端设置有导平面。

[0018] 优选的,一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机的抛光方法,包括如下步骤:

[0019] 步骤一:将介质陶瓷片放入陶瓷片传送格内,启动旋转电机,带动传动带与抛光轮转动,同时喷水口喷出水;

[0020] 步骤二:陶瓷片经过第一平面抛光机构的下方,抛光轮转动对陶瓷片的第一面进行打磨抛光,喷水口喷出的水将打磨产生的灰尘带走,通过漏水孔流入下方的集水箱内,通过出水口排走;

[0021] 步骤三:传动带转动带动陶瓷片传送格内的陶瓷片向后移动,进入第一翻转槽内,陶瓷片的一侧向下陷入第一导斜面内,另一侧继续被陶瓷片传送格带动向后移动,陶瓷片逐渐进入第一压制面的下方,直立面将陶瓷片的另一侧抬起,使陶瓷片逐渐立起进入直立导轨内,陶瓷片被带动经过第一侧边抛光机构的下方,边角被抛光轮打磨抛光,喷水口喷出的水将打磨产生的灰尘带走,通过漏水孔流入下方的集水箱内,通过出水口排走;

[0022] 步骤四:陶瓷片继续向后移动,上方被第二压制面向一侧压,陶瓷片的另一侧旋转至第二限制面,从第一翻转槽内脱离后,陶瓷片的第二面被翻转至上方,经过第二平面抛光机构的下方,抛光轮将陶瓷片的第二面打磨抛光,喷水口喷出的水将打磨产生的灰尘带走,通过漏水孔流入下方的集水箱内,通过出水口排走;

[0023] 步骤五:陶瓷片继续向后移动,移动至第二翻转槽处,重复步骤三,将陶瓷片的另一侧也打磨完成,重复步骤四,将陶瓷片翻转,移动至传动带末尾,将陶瓷片收集即可。

[0024] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0025] 1、本发明通过在传动带的内部设置陶瓷片翻转垫板,陶瓷片翻转垫板上设置有第一翻转槽,在介质陶瓷片经过第一平面抛光机构的打磨抛光后,移动至第一翻转槽内时,可被第一翻转槽内的第一导斜面、第一限制面、直立面和第一压制面带动翻起,使陶瓷片直立,以便对陶瓷片的侧边打磨抛光,继续向后移动,陶瓷片被第二压制面、第二导斜面、第二限制面和导平面翻转,将原陶瓷片的下端面翻转至上方,以便第二平面抛光机构对陶瓷片的另一面进行打磨抛光,陶瓷片再经过第二翻转槽,重复第一翻转槽的步骤,将陶瓷片的另一侧边进行打磨抛光,避免现有铁氧体介质陶瓷片加工磨粒流抛光时产品损坏率较高,使用砂磨机抛光时翻转陶瓷片较为麻烦,在处理大批量铁氧体介质陶瓷片时效率较低的问题发生。

[0026] 2、通过在传动带上设置陶瓷片传送格,可将陶瓷片卡在陶瓷片传送格内,被陶瓷片传送格移动,陶瓷片的最高点始终位于陶瓷片传送格内,以便使陶瓷片进入第一翻转槽内后陶瓷片传送格可继续带动其移动,在对陶瓷片进行打磨抛光时喷水口喷出的水可将打磨产生的粉尘压下,并且将其通过漏水孔带走,避免产生扬尘,污染车间与设备,同时在第一平面抛光机构、第一侧边抛光机构、第二平面抛光机构和第二侧边抛光机构的下方均设置抛光机构定位台,可将四个抛光机构架起,避免抛光机构内的抛光轮下压将陶瓷片磨薄,使陶瓷片产生次品的问题发生。

## 附图说明

[0027] 图1为本发明的整体侧视结构示意图;

[0028] 图2为本发明的传送机构结构示意图;

[0029] 图3为本发明的陶瓷片翻转垫板结构示意图;

[0030] 图4为本发明的整体前视结构示意图;

[0031] 图5为本发明的第一翻转槽结构示意图;

[0032] 图中:1、自动翻转砂磨抛光机;2、传动带;3、陶瓷片传送格;4、陶瓷片翻转垫板;5、第一滑动面;6、第一翻转槽;7、第二滑动面;8、第二翻转槽;9、第一导斜面;10、第一限制面;11、直立面;12、第一压制面;13、直立导轨;14、第二压制面;15、第二导斜面;16、第二限制面;17、导平面;18、传送传动机构;19、旋转电机;20、电机固定座;21、第一平面抛光机构;22、第一侧边抛光机构;23、第二平面抛光机构;24、第二侧边抛光机构;25、抛光传动机构;26、抛光机构定位台;27、抛光轮;28、喷水口;29、砂磨机架;30、电机台;31、集水箱;32、出水口;33、传送机构;34、漏水孔。

## 具体实施方式

[0033] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0034] 请参阅图1-5,本发明提供了一种实施例:一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机,包括自动翻转砂磨抛光机1,自动翻转砂磨抛光机1的中间设置有传送机构33;

[0035] 还包括:

[0036] 传动带2,其设置在传送机构33的中间,且传动带2与传送机构33的转轴啮合连接,传动带2上设置有多陶瓷片传送格3,且传动带2与陶瓷片传送格3为一体结构,传动带2的内部设置有多漏水孔34,且传动带2与内部的漏水孔34为一体结构;

[0037] 陶瓷片翻转垫板4,其设置在传动带2的内部,且陶瓷片翻转垫板4与传送机构33焊接连接,陶瓷片翻转垫板4的上方内部设置有六个第一翻转槽6,且六个第一翻转槽6与陶瓷片翻转垫板4为一体结构,且陶瓷片翻转垫板4的内部设置有多漏水孔34,且陶瓷片翻转垫板4与内部的漏水孔34为一体结构;

[0038] 第一平面抛光机构21,其设置在传送机构33的上方前端,第一平面抛光机构21的后方设置有第一侧边抛光机构22,第一侧边抛光机构22的后方设置有第二平面抛光机构23,第二平面抛光机构23的后方设置有第二侧边抛光机构24,且第一平面抛光机构21、第一侧边抛光机构22、第二平面抛光机构23和第二侧边抛光机构24均通过螺钉与传送机构33连接,第一翻转槽6与第二翻转槽8可将陶瓷片翻转,以便对陶瓷片的两面进行打磨抛光。

[0039] 请参阅图1和4,第一平面抛光机构21、第一侧边抛光机构22、第二平面抛光机构23和第二侧边抛光机构24的下方中间均设置有抛光轮27,抛光轮27的上方设置有喷水口28,喷水口28连接到水管,设备开启后可从喷水口28喷出水,将打磨产生的灰尘压制并且带走,避免产生扬尘污染车间损坏设备。

[0040] 请参阅图1、2和4,第一平面抛光机构21、第一侧边抛光机构22、第二平面抛光机构23和第二侧边抛光机构24的一侧下方均设置有抛光传动机构25,且四个抛光传动机构25分别与四个抛光机构链条连接,四个抛光传动机构25的另一侧下方均设置有旋转电机19,且四个抛光传动机构25均与另一侧下方的旋转电机19轴连接,抛光传动机构25的前后端均设置有抛光机构定位台26,且抛光机构定位台26与传送机构33焊接连接,电机可带动传动带2与抛光轮27转动,以便将陶瓷片传送与打磨抛光。

[0041] 请参阅图1、2和4,传送机构33的下方设置有砂磨机架29,且砂磨机架29通过螺钉与传送机构33连接,传送机构33的一侧前端设置有传送传动机构18,且传送传动机构18与传送机构33的转轴链条连接,且传送传动机构18的另一侧下方设置有旋转电机19,且传送传动机构18与另一侧下方的旋转电机19轴连接,砂磨机架29可将设备架起,以便工人进行操作。

[0042] 请参阅图1和4,旋转电机19的下方设置有电机固定座20,且旋转电机19与电机固定座20嵌入式连接,电机固定座20的下方设置有电机台30,且电机固定座20通过螺钉与电机台30连接,且电机台30与砂磨机架29焊接连接,电机台30可将电机架起,避免电机与传动设备距离过长产生动力损耗。

[0043] 请参阅图4,传送机构33的下方设置有集水箱31,且集水箱31与砂磨机架29焊接连接,集水箱31的前端设置有出水口32,且出水口32与集水箱31为一体结构,集水箱31可将上方流下的水收集,并通过出水口32排走,避免水流到电机上,破坏设备。

[0044] 请参阅图3,第一翻转槽6的前方设置有第一滑动面5,且第一滑动面5与陶瓷片翻转垫板4为一体结构,第一翻转槽6的后端设置有第二滑动面7,且第二滑动面7与陶瓷片翻转垫板4为一体结构,第二滑动面7的后端设置有六个第二翻转槽8,且六个第二翻转槽8与陶瓷片翻转垫板4为一体结构,陶瓷片在第一滑动面5上移动时不翻转,以便将陶瓷片的一

面进行打磨抛光,再经过第一翻转槽6、第二滑动面7和第二翻转槽8分别将陶瓷片立直与翻转,以便对其他面进行打磨抛光。

[0045] 请参阅图3和5,第一翻转槽6与第二翻转槽8的内部前端均一体设置有第一导斜面9,第一导斜面9的后端设置有直立面11,第一导斜面9的一侧设置有第一限制面10,第一限制面10的后端设置有第一压制面12,直立面11与第一压制面12之间的后端设置有直立导轨13,直立导轨13的后端另一侧设置有第二压制面14,第二压制面14的一侧设置有第二导斜面15,第二压制面14的后端设置有第二限制面16,第二导斜面15的后端设置有导平面17,陶瓷片经过第一导斜面9,一侧会被第一导斜面9的下凹面向下引导,另一侧向前移动时会被直立面11向上推,从而将陶瓷片立起,立起后再经过第二压制面14与第二导斜面15可将其放倒,完成对陶瓷片的翻转,以便对陶瓷片进行打磨。

[0046] 进一步,一种旋磁铁氧体介质陶瓷加工用砂磨机的抛光方法,包括如下步骤:

[0047] 步骤一:将介质陶瓷片放入陶瓷片传送格3内,启动旋转电机19,带动传动带2与抛光轮27转动,同时喷水口28喷出水;

[0048] 步骤二:陶瓷片经过第一平面抛光机构21的下方,抛光轮27转动对陶瓷片的第一面进行打磨抛光,喷水口28喷出的水将打磨产生的灰尘带走,通过漏水孔34流入下方的集水箱31内,通过出水口32排走;

[0049] 步骤三:传动带2转动带动陶瓷片传送格3内的陶瓷片向后移动,进入第一翻转槽6内,陶瓷片的一侧向下陷入第一导斜面9内,另一侧继续被陶瓷片传送格3带动向后移动,陶瓷片逐渐进入第一压制面12的下方,直立面11将陶瓷片的另一侧抬起,使陶瓷片逐渐立起进入直立导轨13内,陶瓷片被带动经过第一侧边抛光机构22的下方,边角被抛光轮27打磨抛光,喷水口28喷出的水将打磨产生的灰尘带走,通过漏水孔34流入下方的集水箱31内,通过出水口32排走;

[0050] 步骤四:陶瓷片继续向后移动,上方被第二压制面14向一侧压,陶瓷片的另一侧旋转至第二限制面16,从第一翻转槽6内脱离后,陶瓷片的第二面被翻转至上方,经过第二平面抛光机构23的下方,抛光轮27将陶瓷片的第二面打磨抛光,喷水口28喷出的水将打磨产生的灰尘带走,通过漏水孔34流入下方的集水箱31内,通过出水口32排走;

[0051] 步骤五:陶瓷片继续向后移动,移动至第二翻转槽8处,重复步骤三,将陶瓷片的另一侧也打磨完成,重复步骤四,将陶瓷片翻转,移动至传动带2末尾,将陶瓷片收集即可。

[0052] 对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

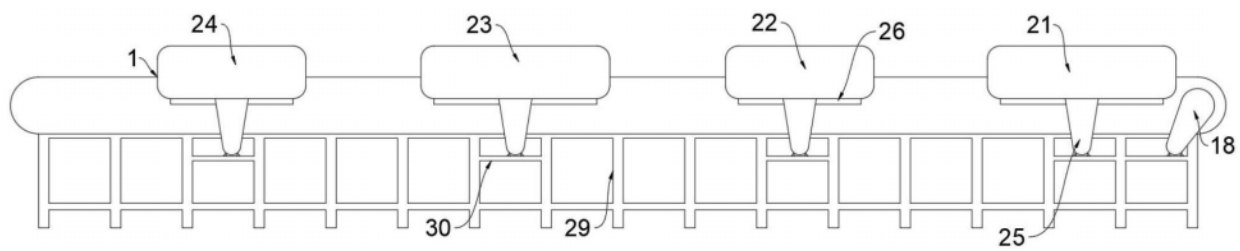


图1

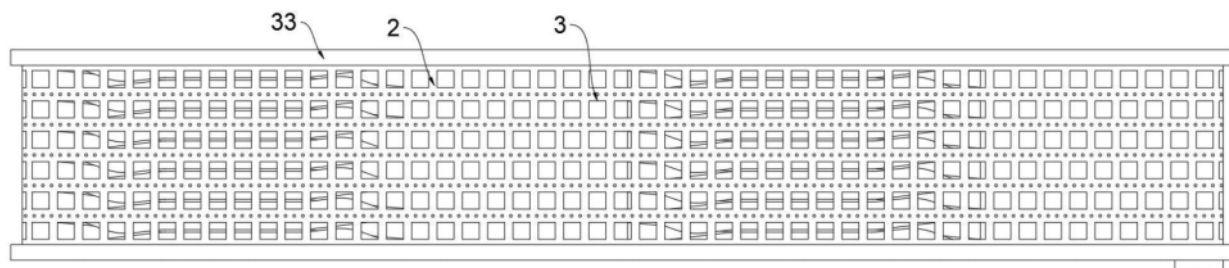


图2

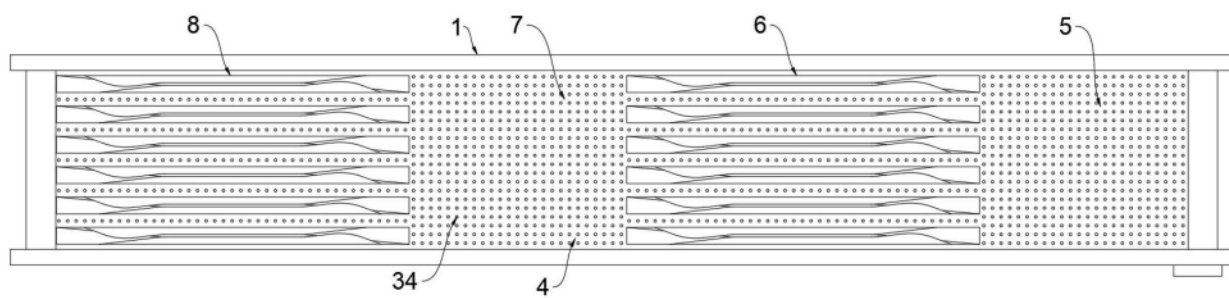


图3

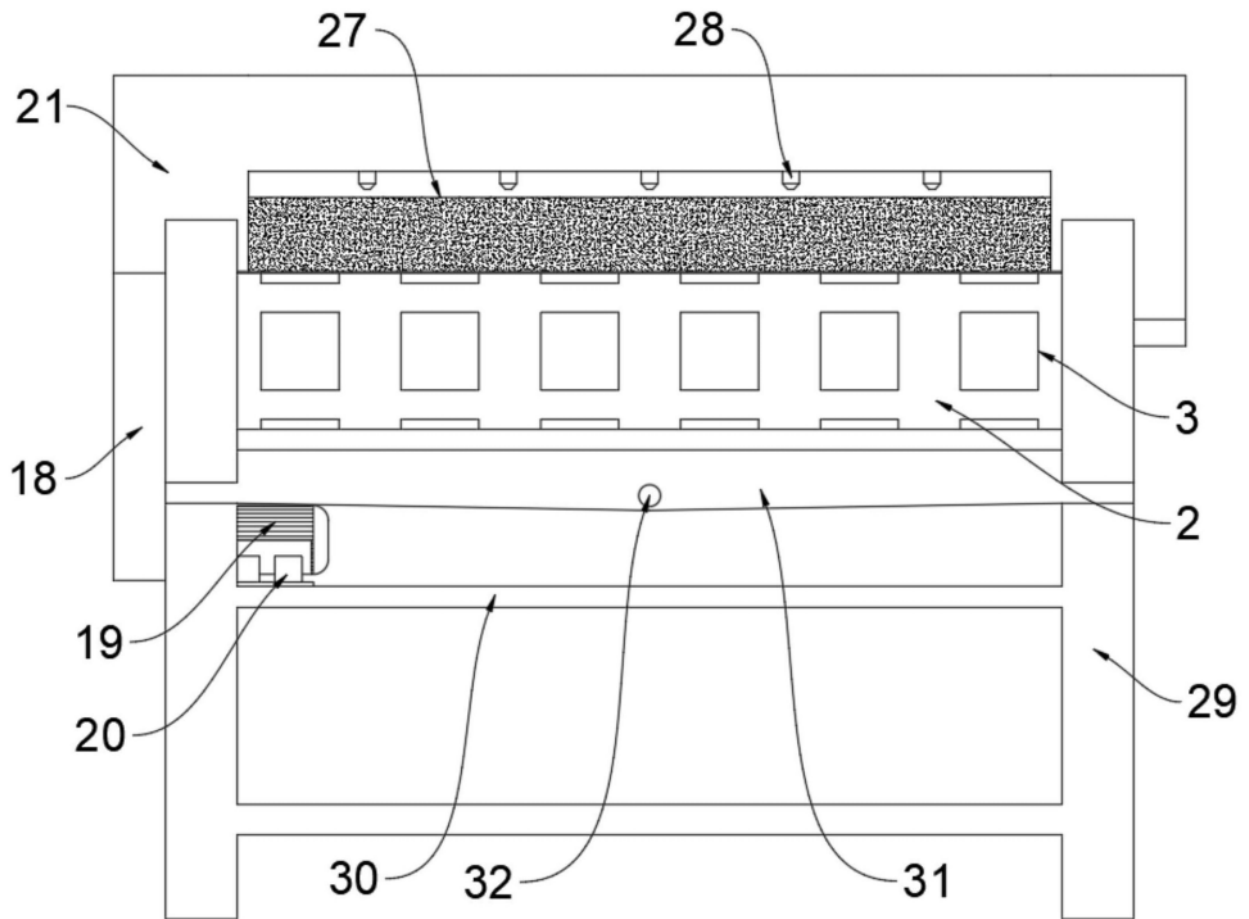


图4

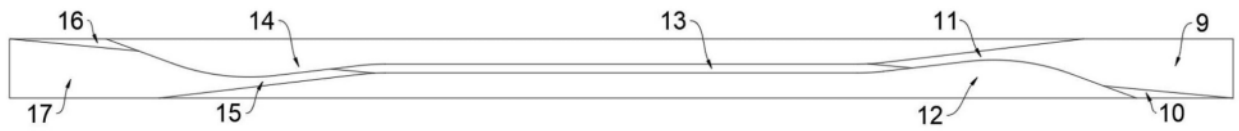


图5